

2024年度 大阪公立大学 半導体デバイスプロセス技術基礎講座 (会員有料制)

於:大阪公立大学 i-siteなんば および オンライン



第1回	4月24日	最新の国内・世界の半導体および市場動向と展望	和田木 哲哉 氏	モルガンスタンレーMUFJ証券(株)
第2回	5月9日	ALD/ALEプロセスの基礎と応用	霜垣 幸浩 教授	東京大学 工学系研究科
第3回	5月20日	リソグラフィの基礎と最先端の現状	永原 誠司 氏	東京エレクトロン(株)
第4回	6月7日	プラズマエッチングの基礎と最先端の現状	堀 勝 特任教授	名古屋大学 低温プラズマ科学研究センター
第5回	7月19日	パワーデバイスの基礎と最新動向	上田 哲三 氏	パナソニックインダストリ(株)
第6回	8月9日	半導体IC設計技術とその最新動向	吉河 武文 教授	富山県立大学 理工学研究科
第7回	8月30日	半導体チップレットと3D集積の基礎と最先端	井上 史大 准教授	横浜国立大学 工学研究院
第8回	9月27日	半導体洗浄技術の基礎と最先端技術トレンド	岩畑 翔太 氏	Screenホールディングス(株)
第9回	10月21日	レジスト、感光性ポリイミドの基礎と最先端動向	上野 巧 特任教授	信州大学
第10回	11月27日	半導体支持基板の基礎と最新状況	片桐 規貴 氏	新光電気工業(株)
第11回	12月4日	最先端半導体デバイスBig3の前工程プロセス・デバイス技術とその展望	廣田 良浩 氏	ワイドヴィル
第12回	12月18日	CVDの基礎と応用 (仮)	霜垣 幸浩 教授	東京大学 工学系研究科
第13回	1月8日	Siトランジスタのスケーリング基礎と最先端 (仮)	平本 俊郎 教授	東京大学 生産技術研究所
第14回	1月20日	メタバースの基礎と最先端 (仮)	福嶋 功太郎 氏	カワサキテクノリサーチ(株)
第15回	2月5日	めっき技術基礎と応用 (仮)	藤原 裕 氏	(地独)大阪産業技術研究所
第16回	2月20日	スパッタリング技術の基礎と最先端 (仮)	恒川 孝三 氏	キャノンアネルバ(株)